(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭55-140138

⑤Int. Cl.³
G 01 N 27/12

識別記号

庁内整理番号 6928-2G ❸公開 昭和55年(1980)11月1日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

## 図酸素ガス分圧検知素子

願 昭54-48460

②出 願 昭54(1979)4月18日

仰発 明 者 佐藤富

②特

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑫発 明 者 大谷光弘

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑰発 明 者 日下部健治

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

@発 明 者 広居信雄

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

切出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

仰代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

明 紐 書

1、発明の名称

酸素ガス分圧検知素子

2、 特許請求の範囲

酸化チョン機結体よりなり、この機結体は相対 密度O.7~O.5の多孔質体であって、この多孔質 体は平均粒径1~5 μmの酸化チョン粒子 が相互 に部分的に溶着しているネック部分により前記酸 化チョン粒子が三次元的に結ばれているものであ り、前記ネック部分の平均断面積は前記酸化チョン粒子の平均断面積の1/2~1/5 であり、 さらに 前記焼結体中に複数本の電極線が埋め込まれていることを特徴とする酸素ガス分圧検知素子。

3、発明の詳細な説明

この発明は酸素ガス分圧検知素子に関する。さらに詳しくは、酸化チタンの多孔質焼結体よりなり、その抵抗値により雰囲気中の酸素ガス分圧を 校知する素子に関する。本発明の目的は、酸素ガス分圧の変化に対して高速に応答すると同時に、 高温度下での連続使用に際して安定性の高い酸素 ガス分圧検知素子を提供することである。

炭化水素を燃料とする燃焼装置、すなわち内燃 機関やガス炉,ストープ,湯沸器,風呂等に適用 して、その燃焼系の埋憩空燃比点を検知できるよ うな燃焼排気ガスセンサのニーズが強まっているo これは理想空燃比点燃焼が燃料の効率や燃焼排ガ ス中の有客成分量などの面で望ましいからである。 理想空燃比点を境にして排ガス中の酸素ガス分圧 が急変することに齎目して、酸化チタン等の酸化 物の抵抗値が雰囲気中の酸素ガス分圧に依存する という性質を利用した排気ガスセンサ、すなわち 酸素ガス分圧検知素子が提案されている。とのよ りな酸素ガス分圧検知案子は、たとえば酸化チタ ンのような半導体酸化物の多孔質焼結体にその質 気抵抗値を取り出すための二本の電極線が埋め込 まれた構造をもち、その具備すべき好ましい要件 を列挙すれば次の通りである。まず第1に気孔率 が充分大きいこと。第2亿多孔質セラミックスを 構成している粒子の形状と大きさがそろっている こと、第3は粒子相互の接触状態に関することで、



## 特開昭55-140138(2)

い多孔率で焼結されたものであり、その具体的な 構成は、酸化チタン焼結体よりなり、この焼結体 は相対密度 O.7 ~ O.5(ルチル型酸化チタンの密 度を1とした場合)の多孔質体であり、この多孔 質体は平均粒径1~5 μmの酸化チタン粒子が相互 に部分的に容惫しているネック部分によりとの酸 化チタン粉子が三次元的に結ばれているものであ って、前記ネック部分の平均断面積が酸化チタン 粒子の平均断面積の1/2~1/5であり、このような 焼結体中に複数本の電極線が埋め込まれていると とを特徴としたものである。とのような酸素ガス 分圧検知素子は、特に吟味して作られた酸化チョ ン粉体を用いて作られる。通常の方法により仮焼、 粉砕して得られた粉体では案子焼成中のクラック の発生や案子の高温使用中のセラミックスの劣化 変質のために作ることは困難である。

次に、本発明による酸素ガス分圧検知案子について、実施例をあげて詳細に説明する。ことに開示する酸素ガス分圧検知素子は、微粉でありながら焼結性が抑制されており、かつ形状ならびに大

発明者等は、酸素ガス分圧検知案子としてより 一層望ましいものを得るべく多面的に追求して、 特に高温排ガス中での長時間の耐久性に優れた業 子を開発した。 すなわち、それは微細な粒子形状 および粒子径がよりそろった酸化チタン粉体が高

きさがそろっている酸化チタン粉体を用いてクリ ーンシート法により作られた。

内容稅200mlの白金るつぼに平均粒径0.2μmのアナターゼ型酸化チタン粉体40gを入れ、この白金るつぼをアルミナるつぼに収納した。アルミナるつぼは鉛直方向に対して約40g傾壁を貨働してかり、かつこの軸は毎分18回転で自転でするものである。このような装盤によりるつで分時間の速度であめ、所定の温度で2時間仮焼したのち、炉中放冷した。粉体仮焼温度を1050℃,1150℃,1250℃として一連の粉体試料を作った。また、同じ装置を用いて、るつぼを回転せずに静止したままで、他の条件は変えずに比較試料としての粉体を作った。

意思

るつぼを静止して仮焼したものはケーキ状固塊 となったので、との固塊を乳針で粗粉砕し、その 後通常のポットミルで約1 μm の平均粉径となる まで粉砕した。一方、るつぼを回転しながら仮焼 したものはケーキ状固塊とならず、微粉砕する必要がなかった。

これらの酸化チョン粉体とブチョール樹脂、可 塑剤としてのジフチルフタレート、有機溶媒とを 混練してスラリーを作り、とのスラリーから公知 の方法でグリーンシートを作製した。 グリーンシ ートは約0.5mの厚さをもつ。このシートから直 径344の円板を打ち抜き、この円板2枚の間に直 径0.25 50 の白金線電板を1.5 50 の間隔で平行に 挾み込んで、2枚の円板を接合した。このとき、 円板の接合されるべき面に少量の有機溶媒を与え たのち、接合して、軽く加圧した。とのようにし て作られたものを高温で1時間空気中焼成して、 酸化チタン多孔質焼結体よりなる酸素ガス分圧検 知素子の試料を作った。 ここにおいて、グリーン シート作製に用いた仮焼された粉体ならびに仮焼 後に粉砕された粉体について、走査型電子顕微鏡 により粒子の形状と粒子径を観測し、多孔質焼結 . 体素子について相対密度ならびに粒子の結合状態 を調べた。ただし、るつぼを静止して仮焼し粉砕 して得られた粉体については、粒子の形状が不規則で粒径を定量的に捉えにくいので、コールタカウンタにより平均的粒径をとっている。また、密度測定は、素子試料は小さくてかつ電極線が埋め込まれているため不適当な大きの試片を切り取り、素子と同時に焼成した多孔質片の破断面を走査型電子顕微・すると、いわゆるネック断面積との出ての平均ネック断面積との出の値を求めた。下表はこのようにして得られた各試料についてのデータである。

以下余白

ネック断面積 粒 子断 面積	14.0	0.47	9 8.0	0,43	68.0	0.40
案子平均 数 径 (μm)	2.1	3.6	2.7	2.3	8.	2.8
表子焼成 素子相対 温 度 密 度	69.0	0,67	99.0	0,67	69.0	08.0
	1 200	1400 0.67	1 300	1 300	1200	1 200
粉体の 平均粒径 (/m)	9.0	4.	1.2	4.	4.	F.
多体仮既条件	るつ何回転1060℃	るつぼ回転 1260℃	るつぼ回転 1150℃	ろつぼ回転 1250℃	るン暦回覧 1250℃	3つ頃静止1160℃
表 本 数 卷 号	-	N	м	4	ø	φ

次に、とれら酸素ガス分圧検知案子試料をブロ パンガスパーナにより燃料過剰側燃焼のもとで 1000℃の排ガス温度で 長時間の苛酷耐久テス トにかけた。その結果、表中の試料番号1と6の 素子は、耐久試験時間の経過とともに次第に抵抗 値が減少して行くが、試料番号2~5の素子は抵 抗値減少が軽微であった。これは、 案子 1 の場合 には、粉体仮焼温度および紫子焼成温度が低すぎ て、耐久試験中に多孔質体になんらかの質的変化 があったためであり、煮子8の場合には、1200 ℃で素子が焼成されていながら、すでに相対密度 が80多と大きいことから、焼結しやすい性質を もっているとみられ、とのテストのような酸素不 足の高温雰囲気中ではセラミックスの質的変化が あったものと考えられる。また、ブロパンガスパ ーナの燃焼状態を理想空燃比点の片側から他側に 瞬間的に切り替え、この変化に対する素子の応答 速度を評価した。試料番号1~6の素子の応答速 **쮵はいずれも0.1 秒から0.3 秒の間にあってとの** 値は実用上有用な高速度である。

以上の実施例から明らかであるように、要中の試料番号2~5のものは相対密度がO.7~O.5の酸化チタン多孔質焼結体であって、その平均粒径は1~5μmであり、ネック部の平均断面積は粒子平均断面積の1/2~1/6である酸素ガス分圧検知を予まって、応答性ならびに耐久性ともにすずれるり、広く燃焼機器にとりつけられる有用なものである。そして、このような業子は酸化チタンを特殊な仮焼法により処理して粒形および粒子をがよくそろった、破砕面の少ない、焼結性の抑制された粉体をより高い温度で焼成してはじめて得られるものである。

代埋人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

DERWENT-ACC-NO:

1980-90915C

DERWENT-WEEK:

198051

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Sensor element for measuring oxygen

partial pressure -

has porous semiconductor made from

sintered titanium

oxide

PATENT-ASSIGNEE: MATSUSHITA ELEC IND CO LTD[MATU]

PRIORITY-DATA: 1979JP-0048460 (April 18, 1979)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 55140138 A

November 1, 1980

N/A

000

N/A

INT-CL (IPC): G01N027/12

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 55140138A

BASIC-ABSTRACT:

Element is composed of a porous semiconductor made of sintered titanium oxide

and a number of electrodes embedded in the semiconductor.

The sintered

titanium oxide has a relative density of 0.5-0.7. The porous sinter is

composed of titanium oxide particles having ave. particle size of 1-5 microns,

which are three-dimensionally fused together through 'necks'. The ave.

cross-sectional area of the fusion necks is 1/2-1/5 of ave. cross-sectional

area of the titanium oxide particles.

The sensor element is used for measuring O2 partial pressure in exhaust gas of internal combustion engines for the purpose of controlling

A/F (air/fuel) ratio. The sensor element exhibit improved durability when used in contact with high-temp. gas.

TITLE-TERMS: SENSE ELEMENT MEASURE OXYGEN PRESSURE POROUS

SEMICONDUCTOR MADE

SINTER TITANIUM OXIDE

DERWENT-CLASS: E36 J04

CPI-CODES: E31-D; J04-C04;

CHEMICAL-CODES:

Chemical Indexing M3 \*01\*

Fragmentation Code

C810 C108 C550 N000 Q435 P832 M740 M750 M411 M902